

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 5 部門第 2 区分

【発行日】平成27年8月27日(2015.8.27)

【公開番号】特開2014-222077(P2014-222077A)

【公開日】平成26年11月27日(2014.11.27)

【年通号数】公開・登録公報2014-065

【出願番号】特願2013-101108(P2013-101108)

【国際特許分類】

F 1 7 C 11/00 (2006.01)

C 0 1 B 3/00 (2006.01)

【F I】

F 1 7 C 11/00 C

C 0 1 B 3/00 Z

【手続補正書】

【提出日】平成27年7月9日(2015.7.9)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項 3

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項 3】

前記吸蔵体は、前記導電陰極の表面に積層し、

前記プロトン伝導体は、前記吸蔵体を前記導電陰極と共に挟み込むように積層すると共に、前記導電陰極の裏面に積層し、

前記導電陰極の裏面に積層したプロトン伝導体を前記導電陰極と共に挟み込むように配置され、前記導電陰極よりも高い電位になるように前記電源によって電圧が印加される陽極を備える

請求項 2 に記載の水素吸蔵装置。